

SMLOUVA O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ

Národního centra kompetence Centrum elektronové a fotonové optiky

uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, mezi těmito smluvními stranami:

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

IČ: 68081731

DIČ: CZ68081731

Sídlo: Královopolská 147, 612 00 Brno

Jednající: prof. Ing. Josef Lazar, Dr., ředitel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu/kód banky: 372707963/0300

Uchazeč (dále jen jako „ÚPT“)

a

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

IČ: 60077344

DIČ: CZ60077344

Sídlo: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Jednající: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., ředitel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu/kód banky: 600773445/ 0300

Další účastník č. 1 (dále jen jako „BC“)

a

CRYTUR, spol. s r. o.

IČ: 25296558

DIČ: CZ25296558

Sídlo: Na Lukách 2283, 511 01 Turnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13937

Jednající: Dr. Jindřich Houžvička, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu/kód banky: 27-788590287 / 0100

Další účastník č. 2 (dále jen jako „CRYTUR“)

a

České vysoké učení technické v Praze

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 – Dejvice

Jednající: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu/kód banky: 19-5505030267/0100

Další účastník č. 3 (dále jen jako „ČVUT“)

a

Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

IČ: 46971629

DIČ: CZ46971629

Sídlo: Vlastimila Pecha 1282/12, 627 00 Brno, Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7300

Jednatel: RNDr. Petr Střelec, jednatel

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu/kód banky: 373519024/2700

Další účastník č. 4 (dále jen jako „TFS“)

a

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

Jednatel: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu/kód banky: 2106535627/2700

Další účastník č. 5 (dále jen jako „FZÚ“)

a

Masarykova univerzita

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

Jednatel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu/kód banky: 85636621/0100

Další účastník č. 6 (dále jen jako „MU“)

a

Meopta – optika, s. r. o.

IČ: 47677023

DIČ: CZ47677023

Sídlo: Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51239

Jednatel: Alena Moore, jednatel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu/kód banky: 17188003/0300

Další účastník č. 7 (dále jen jako „MEOPTA“)

a

MESING, spol. s r. o.

IČ: 25579835

DIČ: CZ25579835

Sídlo: Šámalova 1537/60a, 615 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35307

Jednatel: Ing. Richard Wíttek, jednatel

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu/kód banky: 35035000/2700

Další účastník č. 8 (dále jen jako „MESING“)

a

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

Sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Jednající: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu/kód banky: 19-1096330227/0100

Další účastník č. 9 (dále jen jako „JPOL“)

a

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

IČ: 67985882

DIČ: CZ67985882

Sídlo: Chaberská 1014/57, 182 00, Praha 8

Jednající: doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu/kód banky: 94-11027081/0710

Další účastník č. 10 (dále jen jako „ÚFE“)

a

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

IČ: 61389021

DIČ: CZ61389021

Sídlo: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha

Jednající: RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu/kód banky: 101256398/0300

Další účastník č. 11 (dále jen jako „ÚFP“)

a

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

IČ: 61389013

DIČ: CZ61389013

Sídlo: Heyrovského náměstí 1888/2, 162 00 Praha 6

Jednající: Dr. Ing. Jiří Kotek, ředitel

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu/kód banky: 900009633/0300

Další účastník č. 12 (dále jen jako „ÚMCH“)

a

Vysoké učení technické v Brně

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Jednající: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., prorektor pro transfer znalostí, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu/kód banky: 107-2917830267/0100

Další účastník č. 13 (dále jen jako „VUT“)

všichni dohromady jako „smluvní strany“ nebo „členové konsorcia“

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Tato smlouva upravuje ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění, využití výsledků výzkumu vytvořených v rámci Národního centra kompetence s názvem Centrum elektronové a fotonové optiky, s identifikačním číslem TN01000008, podpořeného Technologickou agenturou České republiky ve veřejné soutěži Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací národní centra kompetence.
- 1.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že výsledky projektu by měly být využity nejpozději do 5 let od ukončení projektu. V souladu s čl. 15 Všeobecných podmínek projektu je po uplynutí této doby hlavní příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití výsledků za nediskriminujících podmínek všem zájemcům.

2. Výsledky, vlastnická a užívací práva

- 2.1. Přehled výsledků projektu je uveden v Příloze č. 1. Výsledky jsou plně v souladu s cíli projektu.
- 2.2. Rozdělení práv k výsledkům a jejich využití, včetně práv k duševnímu vlastnictví upravuje Smlouva o založení Národního centra kompetence ze dne 31. 5. 2018 (dále jen „Smlouva NCK“) v čl. 10 a v čl. 11.
- 2.3. V souladu s čl. 10 Smlouvy NCK jsou vlastnická práva k jednotlivým výsledkům uvedena v Příloze č. 1 včetně velikosti spoluvlastnických podílů u výsledků, které jsou ve spoluvlastnictví více stran.
- 2.4. Právní ochranu výsledků, včetně úpravy právních vztahů s původci a případné úhrady nákladů na registraci a registrační i udržovací poplatky jsou smluvní strany povinny zajistit v souladu s čl. 11 Smlouvy NCK.
- 2.5. Poskytnutí majetkových práv k výsledkům ve spoluvlastnictví třetí straně je při dodržení zásad mlčenlivosti formulovaných v čl. 14 Smlouvy NCK možné jen se souhlasem všech spoluvlastníků předmětného výsledku. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě upravit vzájemná práva a povinnosti zvláštní smlouvou uzavřenou nejméně 30 dní před poskytnutím majetkových práv k výsledku třetí straně. V případě převodu majetkových práv k výsledkům mezi spoluvlastníky se souhlas ostatních spoluvlastníků nevyžaduje.
- 2.6. Každá ze smluvních stran je jako spoluvlastník předmětného výsledku oprávněna předmětný výsledek užívat pro vlastní potřebu, nebrání-li takovému užívání podmínky zák. č. 130/2002 Sb., Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a pravidla Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Smluvní strany mohou předmětný výsledek, který spoluvlastní, užívat komerčně i nekomerčně. V případě komerčního využití výsledků jednou ze smluvních stran spoluvlastnicích předmětný výsledek náleží dalším smluvním stranám spoluvlastnicím předmětný výsledek odpovídající kompenzace v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Výše odměny, včetně způsobu vyúčtování příjmů z využití společně vlastněného výsledku, bude stvrzena smlouvou mezi spoluvlastníky předmětného výsledku. Tuto smlouvu musí spoluvlastníci uzavřít před využitím společného výsledku.
- 2.7. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o zájmu třetích stran o využití výsledků. Poskytnutí licence ve spoluvlastnictví třetí straně je možné po odsouhlasení všemi spoluvlastníky a za podmínky poskytnutí úplaty třetí stranou minimálně ve výši odpovídající jejich tržní ceně. Smluvní strany, které spoluvlastní předmětný výsledek, jsou povinny v takovém případě upravit vzájemná práva a povinnosti zvláštní smlouvou, uzavřenou nejméně 30 dní před poskytnutím licence třetí straně.

3. Omezení odpovědnosti

- 3.1. Žádná ze smluvních stran nenesou odpovědnost za jakékoliv použití výsledků projektu dalšími smluvními stranami a za případné škody tím způsobené v maximálně možném rozsahu takového omezení odpovědnosti, které dovolují platné právní předpisy.

4. Náhrada škody a sankce

- 4.1. Smluvní strana, která poruší tuto smlouvu, nahradí dalším smluvním stranám způsobenou újmu.
- 4.2. V případě neuzavření smlouvy se spoluvlastníky podle ustanovení odst. 2.5, odst. 2.6 nebo odst. 2.7 je každá smluvní strana, která závazek neporušila, oprávněna vyúčtovat porušující smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé prokázané porušení uvedené povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

5. Důvěrnost údajů

- 5.1. Projekt, způsob jeho řešení ani výsledky jeho řešení nejsou utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že informace, dokumentace a výsledky práce, předané a vzniklé v souvislosti s plněním projektu, mohou být pokládány za důvěrné. Informace o výsledcích projektu povinně dodávané do IS VaV, Rejstřík informací o výsledcích či dalších obdobných rejstříků, budou předány v takové podobě a míře podrobnosti, která bude respektovat ochranu důvěrných informací.
- 5.3. Ochrana důvěrných informací se netýká informací již zveřejněných ve formě publikačních výsledků projektu.

6. Závěrečná ustanovení

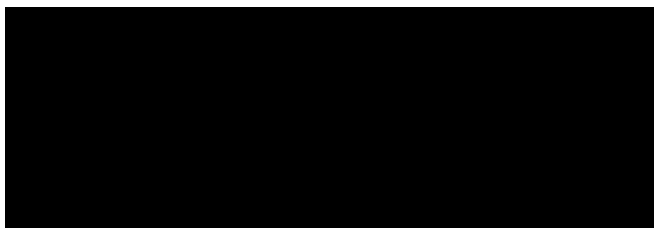
- 6.1. Vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky v této smlouvě blíže neupravené se řídí obecnými ustanoveními o spoluvlastnictví zejména dle § 1115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním anonymizované smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ÚPT. Informaci o zveřejnění zasílá všem smluvním stranám do datových schránek přímo systém Registru smluv. V té souvislosti smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství, které by bylo třeba anonymizovat nad rámec anonymizace údajů požadované zákonem.
- 6.3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 s přehledem výsledků projektu.
- 6.4. Smlouva je vyhotovena v 29 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis obdrží Poskytovatel.
- 6.5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad.

V Brně dne 14.12.2022



Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Ředitel

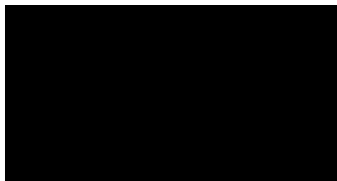
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH dne 16 -12- 2022



LOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v.v.i.
Branšovská 1160/31
370 05 České Budějovice
IČ 600 77 344 (1)

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc.
Ředitel

v TURNOVĚ dne 14. 12. 2022



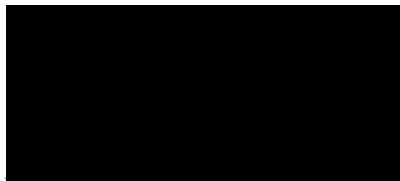
CRYTUR, spol. s r. o.
Dr. Jindřich Houžvička
Jednatel



CRYTUR, spol. s r. o.
Na Lukách 2283
CZ-511 01 TURNOV

IČ: 25296558,
DIČ: CZ25296558 

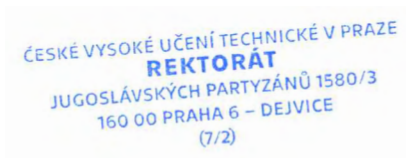
V PRAZE dne 22-12-2022



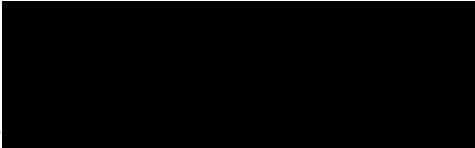
České vysoké učení technické v Praze

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Rektor



V BRNE[✓] dne 14.12.2022

.....


Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o.
RNDr. Petr Střelec
Jednatel

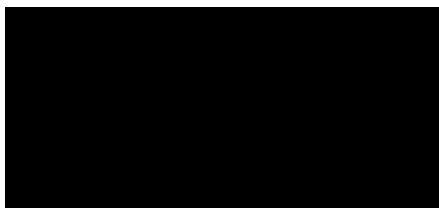
V Praze dne 19. 11. 2021



Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Ředitel


Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2
- 1 -

V  dne 19. 12. 2022



MASARYKOVA
UNIVERZITA

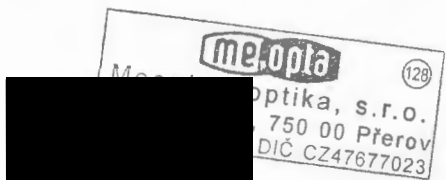
Masarykova univerzita
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Rektor

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno 

Přerově

15.12.2022

V dne



.....

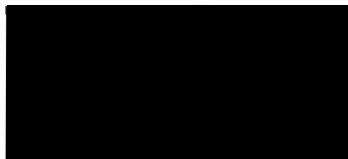
Meopta – optika, s. r. o.

Alena Moore

Jednatel



V^{BRNE}..... dne^{14 11 2022}.....

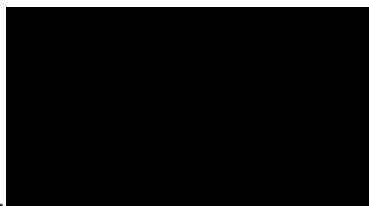


MESING, spol. s r. o.

Ing. Richard Wittek

Jednatel

V Olomouci dne 20. 12. 2021



UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

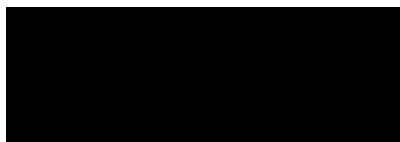
rektorát

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

-1-

Univerzita Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Rektor

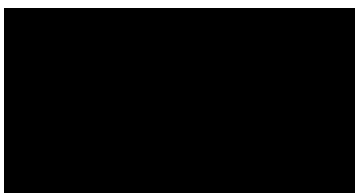
v Praze dne 14 -12- 2022



Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.
Ředitel

**ÚSTAV FOTONIKY
A ELEKTRONIKY AV ČR, v. v. i.**
Chaberská 1014/57, 182 00 Praha 8
IČ: 67985882 DIČ: CZ67985882

V dne 16. 12. 2022



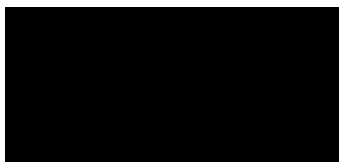
ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU
AV ČR, v.v.i. ①
Za Slovankou 1782/3, 18200 Praha 3

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.

Ředitel

V *Praze* dne *14. 12. 2022*



Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
IČO 61389013
(6)

.....
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Dr. Ing. Jiří Kotek

Ředitel

V Brně dne13.1.2023.....



Vysoké učení technické v Brně

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Prorektor

V Brně 15. února 2022
Čj.: 028/90110/22

PLNÁ MOC

Vysoké učení technické v Brně se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ 00216305, zřízené dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

zastoupené

doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL.M., rektorem

z m o c ň u j e

doc. Ing. Jana Pěňčíka, Ph.D.

prorektora pro transfer znalostí Vysokého učení technického v Brně

k zastupování a jednání za VUT při podpisu veškerých listin a smluv v oblasti:

- a) přihlášek vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a dalších práv průmyslového vlastnictví evidovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a obdobných zápisných úřadů jiných států a regionů,
- b) všech podání spojených s těmito přihláškami a příkazních smluv pro patentové zástupce k zajištění těchto úkonů,
- c) dokumentů řešených v kompetenci Odboru transferu technologií Rektoratu VUT, zejména smluv o převodu práv na předmět průmyslového vlastnictví, smluv o poskytnutí odměny původcům za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví, smluv o spoluvlastnictví práv duševního vlastnictví, licenčních smluv, smluv o využití výsledků výzkumu a vývoje a dohod o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací,
- d) licenčních smluv nakladatelských.

[Redacted signature area]

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

doc. Ing. Jan Pěňčík, Ph.D.

[Redacted signature area]

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



Příloha č. 1 ke Smlouvě o využití výsledků Národního centra kompetence Centrum elektronové a fotonové optiky

DP	TACR	Řešitel	Označení dle TACR	Druh výsledku	Název	Rozdělení práv dle návrhu DP	Plán. termín dosažení	Skutečný termín dosažení	Jaký bude vlastnický podíl na výsledku v %?
DP30	TN01000008/01	[REDACTED] k	TN01000008/1-V2	Ostatní	Annual Report on activities of the Centre Council 2020	-	31.12.2020	31.12.2020	
DP30	TN01000008/01	[REDACTED]	TN01000008/1-V1	Ostatní	Annual Report on activities of the Centre Council 2019	-	31.12.2019	31.12.2019	
DP30	TN01000008/01	[REDACTED]	TN01000008/1-V3	Ostatní	Annual Report on activities of the Centre Council 2021		31.12.2021	31.12.2021	
DP30	TN01000008/01	[REDACTED]	TN01000008/01 -V0004	Ostatní	Annual Report on activities of the Centre Council 2022		31.12.2022		
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V6	Ostatní	Scientific publication	100% ÚFP	28.02.2020	30.12.2019	100% ÚFP
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V3	Gfunk	Contact tool functional sample	60% ÚFP, 35% Crytur, 5% ÚPT	28.02.2020	28.02.2020	60% ÚFP, 35% Crytur, 5% ÚPT
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V1	Ztech	Verified technology of the 3D correction by contact tool	45% ÚFP, 45% Crytur, 10% ÚPT	31.12.2020	21.12.2020	45% ÚFP, 45% Crytur, 10% ÚPT
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V4	Gfunk	Noncontact tool functional sample	60% ÚFP, 35% Crytur, 5% ÚPT	31.12.2020	27.10.2020	60% ÚFP, 35% Crytur, 5% ÚPT
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V7	Ostatní	Scientific publication	100% ÚFP	31.12.2020	19.11.2020	100% ÚFP
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V2	Ztech	Verified technology of the 3D correction by noncontact tool	45% ÚFP, 45% Crytur, 10% ÚPT	31.12.2020	23.12.2020	45% ÚFP, 45% Crytur, 10% ÚPT
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V5	Ostatní	Methodology for the characterization of the laser rod shape by multi-wave interferometry	ÚFP 80%, ÚPT 5%, CRYTUR 10%, Meopta 5%	30.09.2019	30.09.2019	ÚFP 80%, ISI 5%, CRYTUR 10%, Meopta 5%
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V8	Ztech	Verified technology for 3D correction of laser rod faces with minimized micro-roughness	70% ÚFP, 25% Crytur, 5% ÚPT	31.12.2021	22.12.2021	70% ÚFP, 25% Crytur, 5% ÚPT
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/2-V9	Gfunk	Functional sample of a non-contact correction tool based on focused IBF	60% ÚFP, 10% Crytur, 30% ÚPT	31.12.2021	14.12.2021	60% ÚFP, 10% Crytur, 30% ÚPT
DP08	TN01000008/02	[REDACTED]	TN01000008/02 -V010	Gfunk	Functional sample of multi wave length interferometer for laser rods characterization	ÚFP 85 %, ÚPT 5 %, Crytur 10 %	31.12.2022		ÚFP 85 %, ÚPT 5 %, Crytur 10 %
DP05	TN01000008/03	[REDACTED]	TN01000008/3-V3	Gfunk	Production optics with beam transformation	MEOPTA 100%	31.12.2020	31.12.2020	100% Meopta
DP05	TN01000008/03	[REDACTED]	TN01000008/3-V4	Gfunk	Tunable Fiber Laser	100% ÚFE	31.12.2020	31.12.2020	100% ÚFE
DP05	TN01000008/03	[REDACTED]	TN01000008/03-V1	Ztech	Advanced laser processing by beam profile transformation	FZU Hlase 50%, MEOPTA 50%	31.12.2020	31.12.2020	FZU Hlase 50%, MEOPTA 50%
DP05	TN01000008/03	[REDACTED]	TN01000008/03-V2	Ztech	Laser processing of carbides	ÚPT 100%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 100%
DP14	TN01000008/04	[REDACTED]	TN01000008/4-V3	Gfunk	Phantom for 3D resolution	TFS 70%, VUT 30%	31.12.2020	02.10.2019	VUT 30%, TFS 70%
DP14	TN01000008/04	[REDACTED]	TN01000008/4-V1	Ostatní	Error measurement accuracy methodology	TFS 30%, VUT 70%	31.12.2020	22.12.2020	VUT 70%, TFS 30%
DP14	TN01000008/04	[REDACTED]	TN01000008/4-V4	Ostatní	Conference Abstract	TFS 70%, VUT 30%	31.12.2020	09.09.2020	VUT 40%, UMCH 30%, TFS 30%
DP14	TN01000008/04	[REDACTED]	TN01000008/4-V2	R software	Measuring 3D resolution algorithm (software)	TFS 50%, VUT 50%	31.12.2020	22.12.2020	VUT 50%, TFS 50%
DP14	TN01000008/04	[REDACTED]	TN01000008/4-V5	Gfunk	Helical scanning sample holder	TFS 70%, VUT 30%	31.12.2021	15.11.2021	TFS 70%, VUT 30%
DP14	TN01000008/04	[REDACTED]	TN01000008/04-V006	Fuzit	Sub-micron precision phantom	VUT 100 %	31.12.2022		NEDOSAŽEN VUT 30%, TFS 70%
DP14	TN01000008/04	[REDACTED]	TN01000008/04-V007	Gfunk	Life science sample holder	VUT 100 %	31.12.2022		VUT 100 %
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V2	Gfunk	Special photomask for image distortion measurement of projection optics	MEOPTA 50%, ÚPT 50%	31.12.2020	31.12.2020	50% Meopta, 50% ÚPT
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V4	Gfunk	Optimal DMD wavefront sensor for optical systems assembly	UPOL 40%, MEOPTA 60%	31.12.2020	31.12.2020	60% Meopta, 40% UPOL
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V5	Gfunk	Testing bench for transmission wavefront measurement of optical elements	MUNI-CEITEC 100%	31.12.2020	31.12.2020	MUNI-CEITEC 100%
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V3	Ostatní	Optimal detection schemes of lithographic lens parameters	UPOL 80%, MEOPTA 20%	31.12.2020	31.12.2020	80% UPOL, 20% MEOPTA
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V6	Ostatní	Holographic microscopy of levitating particles	ÚPT 100%	31.12.2020	31.12.2020	100% ÚPT
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V1	Ztech	Wavefront measurement of projection lithography optics by intensity scans	UPOL 10%, MEOPTA 90%	31.12.2020	31.12.2020	90% Meopta, 10% UPOL
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V7	Gfunk	Wavefront sensor based on Phase Retrieval	Meopta 100%	31.12.2021	31.12.2021	Meopta 100%
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V8	Gfunk	Special photomask for wavefront measurement of projection optics	Meopta 50%, ÚPT 50%	31.12.2021	31.12.2021	Meopta 40%, ÚPT 40%, UPOL 20%
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V9	Ostatní	Digital holography for lithographic lens wavefront measurement.	Meopta 10%, ÚPT 90%	31.12.2021	31.12.2021	Meopta 10%, ÚPT 90%
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V10	Ostatní	Optimal detection schemes for the wavefront and distortion metrology	UPOL 80%, Meopta 20%	31.12.2021	31.12.2021	UPOL 80%, Meopta 20%
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V11	Gfunk	DMD wavefront sensor for laser beam characterization	UPOL 40%, Meopta 60%	31.12.2021	31.12.2021	UPOL 40%, Meopta 60%
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V12	Ostatní	Glass mask with sub-micron pinholes.	ÚPT 100%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 100%
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/5-V13	Gfunk	Functional sample of testing bench for high-speed sensing of the direction of reflected light.	VUT 100%	31.12.2021	31.12.2021	VUT 100%
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/05-V014	Ostatní	Fast characterization of image from holographic microscopy.	ÚPT 100 %	31.12.2022		ÚPT 100 %
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/05-V015	Gfunk	Opto-mechanical assembly using DMD for sample scanning in confocal imaging mode	VUT-CEITEC 100 %	31.12.2022		VUT-CEITEC 100 %
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/05-V016	Gfunk	DMD wavefront sensor for microscope objective testing	Meopta 100 %	31.12.2022		Meopta 100 %
DP09	TN01000008/05	[REDACTED]	TN01000008/05-V017	Ostatní	SLM generated Laguerre-Gaussian beams for axial localization	UPOL 100 %	31.12.2022		UPOL 100%
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V1	Gfunk	Adjustable stress-free mounting system	MEOPTA 75%, ČVUT 25%	31.12.2020	31.12.2020	75 % Meopta, 25% ČVUT
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V3	Gfunk	Turning centering head	MEOPTA 70%, ČVUT 30%	31.12.2020	31.12.2020	MEOPTA 70%, ČVUT 30%
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V5	Gfunk	Active vibration suppression of optical devices	MEOPTA 70%, ČVUT 30%	31.12.2020	31.12.2020	70 % Meopta, 30 % ČVUT
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V2	Ztech	Adjustable stress-free mounting system	100 % Meopta	31.12.2020	31.12.2020	100 % Meopta
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V4	Ztech	Turning centering head in the production	100 % Meopta	31.12.2020	31.12.2020	100 % Meopta
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V6	Ztech	Production and Measurement of Conical Ring	MEOPTA 75%, ČVUT 25%	31.12.2021	31.12.2021	MEOPTA 75%, ČVUT 25%
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V7	Ztech	Adaptive control system for active absorption implemented on the low-cost control hardware platform.	MEOPTA 60%, ČVUT 40%	31.12.2021	31.12.2021	MEOPTA 60%, ČVUT 40%
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V8	Ostatní	Methodology for composite/hybrid structures optimizing by FEM	MEOPTA 80%, ČVUT 20%	31.12.2021	31.12.2021	MEOPTA 80%, ČVUT 20%
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/6-V9	Gfunk	Optical Clamp Mount	MEOPTA 80%, ČVUT 20%	31.12.2021	31.12.2021	MEOPTA 80%, ČVUT 20%
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/06-V009	Gfunk	Concept based on the principle of automated air bearing	Meopta 80 %, ČVUT 20 %	31.12.2022		Meopta 80 %, ČVUT 20 %
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/06-V010	Gfunk	Active dynamic absorber with low passive resistances	Meopta 40 %, ČVUT 60 %	31.12.2022		Meopta 40 %, ČVUT 60 %
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/06-V011	Ostatní	Functional analysis of optical mount	Meopta 50 %, ČVUT 50 %	31.12.2022		Meopta 50 %, ČVUT 50 %
DP01	TN01000008/06	[REDACTED]	TN01000008/06-V012	Ostatní	Analysis of optomechanical design of microscope objective lenses	Meopta 20 %, ČVUT 80 %	31.12.2022		Meopta 20 %, ČVUT 80 %
DP03	TN01000008/07	[REDACTED]	TN01000008/7-V2	Ztech	TRL7 Perla C 100W	FZÚ (Hlase) 100%	31.12.2020	31.12.2020	100% FZÚ (Hlase)
DP03	TN01000008/07	[REDACTED]	TN01000008/7-V1	Ztech	Surface structuring of dielectric materials	Crytur 100%	31.12.2020	31.12.2020	Crytur 100%
DP03	TN01000008/07	[REDACTED]	TN01000008/7-V3	Gfunk	Single crystal phosphor component for laser based lighting	Crytur 100%	31.12.2021	20.09.2021	Crytur 100%
DP03	TN01000008/07	[REDACTED]	TN01000008/7-V4	Gfunk	Optical substrates with laser engraving	FZÚ (Hlase) 60%, Crytur 40%	31.12.2021	15.11.2021	FZÚ (Hlase) 60%, Crytur 40%
DP03	TN01000008/07	[REDACTED]	TN01000008/7-V5	Gfunk	Imaging screen of nonsymmetric shape	Crytur 100%	30.09.2021	22.09.2021	Crytur 100%
DP03	TN01000008/07	[REDACTED]	TN01000008/07-V006	Gfunk	Cr-YAG solid state light source for Yb-YAG laser extension to 1.48 um	FZÚ (Hlase) 67%, Crytur 33%	31.12.2022		FZÚ (Hlase) 67%, Crytur 33%
DP25	TN01000008/08	[REDACTED]	TN01000008/8-V4	Gfunk	Apparatus for semi-automated etching of metallographic samples	ÚPT 100%	31.12.2020	30.10.2020	ÚPT 100%
DP25	TN01000008/08	[REDACTED]	TN01000008/8-V1	Ostatní	Publication - Advanced methods of TRIP steel sample preparation and imaging using modern scanning electron microscopy	ÚPT 100%	31.12.2020	12.11.2019	ÚPT 100%
DP25	TN01000008/08	[REDACTED]	TN01000008/8-V2	Ostatní	Publication - Contribution of modern scanning electron microscopy for the study of steels	ÚPT 100%	31.12.2020	01.06.2020	ÚPT 100%

DP25	TN01000008/08		TN01000008/8-V3	Ostatni	Publication - Effect of native oxide on reflectivity of slow and super slow electrons from mild steel surface	ÚPT 100%	31.12.2020	01.08.2020	ÚPT 100%
DP25	TN01000008/08		TN01000008/8-V5	Gfunk	Method and apparatus for automated electropolishing process	ÚPT 100%	31.12.2021	30.10.2021	ÚPT 100%
DP25	TN01000008/08		TN01000008/8-V6	Ostatni	Publications	ÚPT 100%	31.12.2021	18.05.2021	ÚPT 100%
DP25	TN01000008/08		TN01000008/08-V007	Ostatni	Scientific paper	ÚPT 100%	31.12.2022		ÚPT 100%
DP25	TN01000008/08		TN01000008/08-V008	Ostatni	Scientific paper	ÚPT 100%	31.12.2022		ÚPT 100%
DP06	TN01000008/09		TN01000008/9-V2	Gfunk	An optical element that transmits light from a thin transparent pad	ÚPT 90%, Crytur 10%	30.09.2020	30.09.2020	90% ÚPT, 10% Crytur
DP06	TN01000008/09		TN01000008/9-V1	Fuzit	Telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications	MEOPTA 100%	31.12.2020	30.11.2020	Meopta 100%
DP06	TN01000008/09		TN01000008/9-V4	Gfunk	Objective with variable focal spot for LIDT	ÚPT 10%, ÚFP 90%	30.6.2021	30.10.2021	ÚPT 10%, ÚFP 90%
DP06	TN01000008/09		TN01000008/9-V3	Gfunk	Compensated telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications at 257 nm	ÚPT 50%, MEOPTA 50%	30.11.2022	31.12.2022	ÚPT 50%, MEOPTA 50%
DP06	TN01000008/09		TN01000008/9-V005	Gfunk	Compensated telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications at 257 nm	ÚPT 50%, Meopta 50 %	31.11.2022	31.12.2022	ÚPT 50 %, Meopta 50 %
DP24	TN01000008/10		TN01000008/10-V1	Ostatni	An approach to magnetic contrast imaging on bulk and nanoscale domains by shaped beams	ÚPT 100%	31.12.2020	01.10.2020	ÚPT 100%
DP24	TN01000008/10		TN01000008/10-V2	Ostatni	Implementation of vortex beams into an SEM	ÚPT 100%	31.12.2020	01.06.2020	ÚPT 100%
DP24	TN01000008/10		TN01000008/10-V3	Ostatni	Real-time imaging of nanoscale phenomena in SEM	VUT-CEITEC 100%	31.12.2020	01.07.2020	VUT-CEITEC 100%
DP24	TN01000008/10		TN01000008/10-V4	Gfunk	Calibration sample for magnetic contrast imaging in SEM	VUT-CEITEC 80%, TFS 20%	31.12.2021	31.12.2021	VUT-CEITEC 80%, TFS 20%
DP24	TN01000008/10		TN01000008/10-005	Gfunk	Nanoscale calibration sample for magnetic contrast imaging in SEM	VUT-CEITEC 50 %, TFS 50 %	31.12.2022		VUT-CEITEC 50 %, TFS 50 %
DP24	TN01000008/10		TN01000008/10-006	Gfunk	Aperture holder for silicon nitride membranes	ÚPT 100 %	31.12.2022		ÚPT 100 %
DP07	TN01000008/11		TN01000008/11-V2	Gfunk	Fabrication and optimization of dielectric plasmonic metalenses	VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%	31.12.2020	19.11.2020	VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %
DP07	TN01000008/11		TN01000008/11-V3	Ostatni	Geometric-Phase Microscopy for Quantitative Phase Imaging of Plasmonic Metasurfaces	VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%	31.12.2020	20.12.2020	VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %
DP07	TN01000008/11		TN01000008/11-V1	Gfunk	Fabrication and optimization of metallic plasmonic metalenses	VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%	31.12.2019	31.12.2019	VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %
DP07	TN01000008/11		TN01000008/11-V4	Gfunk	Polarization Manipulation Using a Dielectric Metasurface	VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%	31.12.2021	14.12.2021	VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %
DP07	TN01000008/11		TN01000008/11-V005	Gfunk	Multifunctional optical element based on dielectric metasurface	VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%	31.12.2022		VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V1	Gfunk	Kit for sample preparation	BC 60%, UMCH 30%, ÚPT 10%	31.12.2020	31.12.2020	BC 60%, UMCH 30%, ÚPT 10%
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V2	Ostatni	Structure	BC 70%, UMCH 20%, ÚPT 10%	31.12.2020	20.12.2020	BC 70%, UMCH 20%, ÚPT 10%
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V3	Ostatni	Structural characterization and biodegradation rate of poly(ϵ -caprolactone)/starch blends.	UMCH 100%	31.12.2020	05.06.2020	UMCH 100%
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V4	Ostatni	research report	BC 20%, UMCH 60%, ÚPT 20%	31.12.2020	21.12.2020	BC 20%, UMCH 60%, ÚPT 20%
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V5	Ostatni	Bio-Applicable Metal Nanoparticles	BC 20%, UMCH 20%, ÚPT 60%	31.12.2020	30.11.2020	BC 20%, UMCH 20%, ÚPT 60%
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V6	Ostatni	Publication	BC 20%, UMCH 20%, ÚPT 60%	31.12.2020	31.12.2019	BC 20%, UMCH 20%, ÚPT 60%
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V7	Fuzit	Kit for sample preparation	BC 90%, UMCH 8%, ÚPT 2%	31.12.2022	xii.21	100% BC
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V8	Gfunk	Resin for 3D SEM	BC 10%, UMCH 85%, ÚPT 5%	31.12.2021	11/2021	BC 10%, UMCH 85%, ÚPT 5%
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V9	Gfunk	Blot-free vitrification technique	ÚPT 5%, MUNI - CEITEC 80%, TFS 15%	31.12.2021	12/2021	MUNI-CEITEC 100%
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V010	Gfunk	Improved specimen preparation kit for 3D SEM	BC 85 %, UMCH 10 %, ÚPT 5 %	31.12.2022		BC 85 %, UMCH 10 %, ÚPT 5 %
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V011	Gfunk	Resin for 3D SEM with improved adhesion to bio-samples	BC 10 %, UMCH 85 %, ÚPT 5 %	31.12.2022		BC 10 %, UMCH 85 %, ÚPT 5 %
DP27	TN01000008/12		TN01000008/12-V012	Gfunk	TEM grid temperature controller	MUNI-CEITEC 100 %	31.12.2022		MUNI-CEITEC 100 %
DP11	TN01000008/13		TN01000008/13-V3	Gfunk	Update of the Raman optical activity spectrometer	UPOL 50%, Meopta 50%	28.02.2021	30.06.2021	UPOL 50%, Meopta 50%
DP11	TN01000008/13		TN01000008/13-V4	Gfunk	Update of the Raman spectrometer for the deep UV spectral range	UPOL 50%, Meopta 50%	30.04.2021	31.07.2021	UPOL 50%, Meopta 50%
DP11	TN01000008/13		TN01000008/13-V2	Gfunk	Functional sample of cell compartment optimized for polarized Raman spectroscopy	UPOL 50%, ÚPT 50%	31.12.2020	31.12.2020	UPOL 50%, ÚPT 50%
DP11	TN01000008/13		TN01000008/13-V5	Gfunk	Accessory extending Raman optical spectrometer capabilities	UPOL 40%, Meopta 40%, ÚPT 20%	30.04.2022		UPOL 40%, Meopta 40%, ÚPT 20%
DP11	TN01000008/13		TN01000008/13-V006	Gfunk	Functional sample for calibration of phase retardation	UPOL 50 %, Meopta 50 %	31.12.2022		UPOL 50 %, Meopta 50 %
DP11	TN01000008/13		TN01000008/13-V007	Gfunk	Functional sample of motorized positioning cell with temperature control for ROA spectrometer	UPOL 50 %, ÚPT 50 %	31.12.2022		UPOL 50 %, ÚPT 50 %
DP23	TN01000008/14		TN01000008/14-V1	Gfunk	Advanced hydration system for ESEM	ÚPT 100%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 100%
DP23	TN01000008/14		TN01000008/14-V002	Gfunk	Advanced hydration system for ESEM	IS-100%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 100%
DP04	TN01000008/15		TN01000008/15-V3	Gfunk	Functional sample of setup for 3 axis alignment	MEOPTA 50%, ÚFP 50%	31.05.2020	31.12.2020	50% Meopta, 50% ÚFP
DP04	TN01000008/15		TN01000008/15-V2	Ostatni	Alignment strategies for diffraction limited optics	MEOPTA 50%, CVUT 50%	30.06.2020	30.06.2020	50% Meopta, 50% CVUT
DP04	TN01000008/15		TN01000008/15-V4	Ostatni	Placing the optics into the mechanical parts	MEOPTA 50%, VUT CEITEC 50%	30.06.2020	31.05.2020	50% Meopta, 50% ÚFP
DP04	TN01000008/15		TN01000008/15-V1	Gfunk	Alignment testing sample	MEOPTA 20%, CVUT 80%	31.12.2020	30.06.2020	20% Meopta, 80% CVUT
DP04	TN01000008/15		TN01000008/15-V5	Ztech	Automised alignment of optomechanical system based on advanced detection, algorithms and mechatronics	MEOPTA 70%, ÚFP 30%	31.12.2021	31.12.2021	MEOPTA 70%, ÚFP 30%
DP04	TN01000008/15		TN01000008/15-V6	Ostatni	Analysis of physical methods for centering of optical elements and systems	MEOPTA 20%, CTU 80%	31.12.2021	31.12.2021	MEOPTA 20%, CTU 80%
DP04	TN01000008/15		TN01000008/15-V7	Ostatni	Design of components for advanced adjustment of opto-mechanical systems.	MEOPTA 10%, VUT 90%	31.12.2021	31.12.2021	MEOPTA 10%, VUT 90%
DP16	TN01000008/16		TN01000008/16-V1	Gfunk	Annular aperture for SEM	ÚPT 50%, TFS 50%	31.12.2020	31.12.2020	50% ÚPT, 50% TFS
DP16	TN01000008/16		TN01000008/16-V2	Gfunk	Objective lens extender	ÚPT 40%, TFS 60%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 40%, TFS 60%
DP16	TN01000008/16		TN01000008/16-V4	Ostatni	Annular aperture for SEM	ÚPT 70%, TFS 30%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 70%, TFS 30%
DP16	TN01000008/16		TN01000008/16-V5	Ostatni	Variable objective lens	ÚPT 70%, TFS 30%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 70%, TFS 30%
DP16	TN01000008/16		TN01000008/16-V3	R software	DFProbe	ÚPT 100%	31.12.2019	31.12.2019	ÚPT 100%
DP16	TN01000008/16		TN01000008/16-V6	Gfunk	Extender for NiCOI column with deflectors	ÚPT 50%, TFS 50%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 50%, TFS 50%
DP16	TN01000008/16		TN01000008/16-V7	Gfunk	Graphene Foil Lens Corrector	ÚPT 10%, TFS 90%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 10%, TFS 90%
DP16	TN01000008/16		TN01000008/16-V008	Gfunk	Graphene Foil Lens Corrector	ÚPT 10 %, TFS 90 %	31.12.2022		ÚPT 10 %, TFS 90 %
DP17	TN01000008/17		TN01000008/17-V1	Gfunk	New phase plate for TEM modifying beam phase	ÚPT 40%, TFS 60%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 40%, TFS 60%
DP17	TN01000008/17		TN01000008/17-V2	Ostatni	HR-STEM optimizing algorithm for Cs non-corrected TEM	ÚPT 50%, TFS 50%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 50%, TFS 50%
DP17	TN01000008/17		TN01000008/17-V3	Ostatni	Development and testing of phase plates	ÚPT 60%, TFS 20%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 60%, TFS 40%
DP17	TN01000008/17		TN01000008/17-V4	Ostatni	HR-STEM imaging optimization	ÚPT 60%, TFS 40%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 60%, TFS 40%
DP17	TN01000008/17		TN01000008/17-V5	Ostatni	Phase plates preparation technologies	ÚPT 80%, TFS 20%	30.09.2019	30.09.2019	ÚPT 80%, TFS 20%
DP17	TN01000008/17		TN01000008/17-V6	Gfunk	Si3Nx phase plates	ÚPT 50%, TFS 50%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 50%, TFS 50%
DP17	TN01000008/17		TN01000008/17-V7	Gfunk	Phase plates holder for the cleaning procedures	ÚPT 100%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 100%
DP17	TN01000008/17		TN01000008/17-V008	Gfunk	Si3Nx phase plates covered by conductive layer	ÚPT 50 %, TFS 50 %	31.12.2022		ÚPT 50 %, TFS 50 %
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V1	Gfunk	Optical assembly with high-finesse resonator for frequency stabilization of highly-coherent lasers	ÚPT 55%, BUT SIX 5%, UPOL 5%, IPE 10%, ÚFP 15%, MEOPTA 5%, MESING 5%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 40%, ÚFP 50%, MEOPTA 5%, MESING 5%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V2	Gfunk	Lens for collecting fluorescence from cold quantum objects	ÚPT 15%, BUT SIX 0%, UPOL 60%, IPE 0%, ÚFP 20%, MEOPTA 5%, MESING 0%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 10%, UPOL 60%, MEOPTA 30%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V3	Gfunk	Optical assembly of Free Space Optics communication unit	ÚPT 10%, BUT SIX 60%, UPOL 0%, IPE 0%, ÚFP 20%, MEOPTA 10%, MESING 0%	31.12.2020	20.12.2020	ÚPT 10%, BUT SIX 80%, ÚFP 5%, MEOPTA 5%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V5	Ostatni	Laser source for high resolution spectroscopy	ÚPT 5 %, BUT SIX 0 %, UPOL 0 %, IPE 5 %, ÚFP 0 %, MEOPTA 0 %, MESING 0 %	30.04.2021	31.05.2021	ÚPE 100%

DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V6	Ostatni	Procedures for very fine optical components manufacturing and assembling	ÚPT 0%, BUT SIX 0%, UPOL 0%, IPE 0%, ÚFP 80%, MEOPTA 20%, MESING 0%	31.03.2021	30.04.2021	ÚFP 90%, UPT 10%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V7	Ostatni	Optical frequency references based on microstructured photonic fibres and their use in frequency controlled	ÚPT 100%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 100%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V4	Ztech	Technology to adjust very precise optical standards, cavities and lenses	ÚPT 10%, BUT SIX 5%, UPOL 5%, IPE 0%, ÚFP 70%, MEOPTA 10%, MESING 0%	31.12.2020	21.12.2020	ÚPT 5%, ÚFP 90%, MEOPTA 5%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V8	Ztech	Proven technology for processing complex optical elements of extremely hard materials	ÚPT 20%, ÚFP 80%	31.12.2020	30.12.2020	ÚPT 5%, ÚFP 95%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V9	Gfunk	Paul-type electric trap for trapping charged atomic and molecular ions	ÚPT 60%, UPOL 20%, ÚFP 20%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 60%, UPOL 30%, MESING 10%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V10	Gfunk	The highly-coherent source of optical frequency	ÚPT 40%, IPE 10%, ÚFP 40%, MESING 10%	31.07.2022		ÚPT 40%, IPE 10%, ÚFP 40%, MESING 10%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V11	Gfunk	The compact vacuum chamber for ion trapping and quantum sensing	ÚPT 60%, UPOL 30%, ÚFP 10%	31.12.2022		ÚPT 60%, UPOL 30%, ÚFP 10%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V12	Gfunk	The setup of the free space optical link for dissemination of optical frequencies over atmosphere	ÚPT 20%, BUT SIX 70%, MESING 10%	31.12.2022	20.12.2022	ÚPT 20%, BUT SIX 70%, MESING 10%
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V013	Gfunk	Electronic system for locking the laser frequency on the mode of the optical resonator	ÚPT 70 %, BUT SIX 5 %, UPOL 10 %, UFE 5 %, ÚFP 5 %, MESING 5 %	31.12.2022		ÚPT 70 %, BUT SIX 5 %, UPOL 10 %, UFE 5 %, ÚFP 5 %, MESING 5 %
DP13	TN01000008/18		TN01000008/18-V014	Gfunk	Stabilization unit for free-space optical receiver	ÚPT 20 %, VUT-SIX 70 %, MESING 10 %	31.12.2022	20.12.2022	ÚPT 20 %, VUT-SIX 70 %, MESING 10 %
DP12	TN01000008/19		TN01000008/19-V1	Gfunk	Functional sample of laser rangefinder	MEOPTA 95%, BUT SIX 5%	31.12.2020	20.12.2020	95% Meopta, 5% BUT SIX
DP28	TN01000008/20		TN01000008/20-V1	Gfunk	Cathodoluminescence Detector for the Life SciencesSector	CRYTUR 100%	31.12.2020	31.12.2020	100% Crytur
DP28	TN01000008/20		TN01000008/20-V2	Ostatni	Report on cathodoluminescence imaging possibilities of commercial fluorophore and cathodoluminescence p	BC 35%, ÚPT 35%, CRYTUR 30%	31.12.2020	31.12.2020	40% (Crytur), 40% (BC), 20% (UPT)
DP28	TN01000008/20		TN01000008/20-V3	Ostatni	CL-SEM application in biological research	BC 50%, UPT 25%, CRYTUR 25%	31.12.2020	06.11.2020	40% (Crytur), 40% (BC), 20% (UPT)
DP28	TN01000008/20		TN01000008/20-V4	Ostatni	Methodical procedures for preparation and observation of various types of biological samples using a CL det	BC 30%, ÚPT 20%, CRYTUR 50%	31.12.2021	31.12.2021	BC 30%, ÚPT 20%, CRYTUR 50%
DP28	TN01000008/20		TN01000008/20-V5	Ostatni	Research report	BC 70%, UPT 30%	31.12.2022	04.08.2022	BC 70%, UPT 30%
DP28	TN01000008/20		TN01000008/20-V006	Gfunk	Adapter for sample transfer from HPF system to cryo-scanning electron microscopes	BC 40 %, ÚPT 50 %, CRYTUR 10 %	31.12.2022		BC 40 %, ÚPT 50 %, CRYTUR 10 %
DP28	TN01000008/20		TN01000008/20-V007	Ostatni	Research report	BC 40 %, UPT 30 %, CRYTUR 30 %	31.12.2022		BC 40 %, UPT 30 %, CRYTUR 30 %
DP28	TN01000008/20		TN01000008/20-V008	Ostatni	Research report	BC 40 %, UPT 30 %, CRYTUR 30 %	31.12.2022		BC 40 %, UPT 30 %, CRYTUR 30 %
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V1	Gfunk	Pilot imaging optics for surface quality inspection	ÚPT 70%, BUT CEITEC 10%, ÚFP 5%, MEOPTA 5%, MESING 10%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 80%, VUT-CEITEC 5%, ÚFP 5%, MESING 10%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V2	Gfunk	Laser source for ultra precise interferometry	ÚPT 90%, BUT CEITEC 0%, ÚFP 0%, MEOPTA 10%, MESING 0%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 90%, MEOPTA 10%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V3	Gfunk	Roughness measurement device for optical surfaces	ÚPT 60%, BUT CEITEC 10%, ÚFP 10%, MEOPTA 10%, MESING 10%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 90%, MEOPTA 10%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V5	Ostatni	How levelling and scan line corrections ruin roughness measurement and how to prevent it	BUT CEITEC 100%	31.12.2020	31.12.2020	VUT-CEITEC 100%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V6	Ostatni	Radiation source with variable coherence for interferometry	ÚPT 95%, MEOPTA 5%	31.12.2020	31.12.2020	SI 95%, MEOPTA 5%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V7	Ostatni	Comparison of three focus sensors for optical topography measurement of rough surfaces	ÚPT 95%, MEOPTA 5%	31.12.2020	31.12.2020	SI 95%, MEOPTA 5%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V4	Ztech	Technique for fusion of roughness data sets	ÚPT 0%, BUT CEITEC 70%, ÚFP 10%, MEOPTA 10%, MESING 10%	31.12.2020	31.12.2020	VUT-CEITEC 80%, ÚFP 5%, MEOPTA 5%, MESING 10%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V9	Ztech	Technique for combination of contact and non-contact data on optical elements	ÚPT 40%, BUT CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V8	Gfunk	Large area non-contact topography measurement system for optical elements	ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%	31.12.2022		ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V10	Ztech	Methodology for traceable form and roughness measurements on large optical surfaces	ÚPT 30 %, VUT-CEITEC 50 %, ÚFP 10 %, Mesing 10 %	31.12.2022		ÚPT 30 %, VUT-CEITEC 50 %, ÚFP 10 %, Mesing 10 %
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V011	Gfunk	Large area non-contact topography measurement system for optical elements	ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%	31.12.2022		ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%
DP10	TN01000008/21		TN01000008/21-V012	Ztech	Methodology for traceable form and roughness measurements on large optical surfaces	ÚPT 30 %, VUT-CEITEC 50 %, ÚFP 10 %, Mesing 10 %	31.12.2022		ÚPT 30 %, VUT-CEITEC 50 %, ÚFP 10 %, Mesing 10 %
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V1	Gfunk	New materials for scintillators	ÚPT 0%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 100%	31.12.2020	31.12.2020	CRYTUR 100%
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V3	Ostatni	Conference abstract	ÚPT 80%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 20%	31.12.2020	31.12.2019	ÚPT 80%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 20%
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V4	Ostatni	Paper in proceedings	ÚPT 70%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 30%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 70%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 30%
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V5	Ostatni	Final report	ÚPT 60%, VUT-CEITEC 20%, CRYTUR 20%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 60%, VUT-CEITEC 20%, CRYTUR 20%
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V6	Ostatni	Technical report	ÚPT 10%, VUT-CEITEC 80%, CRYTUR 10%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 10%, VUT-CEITEC 80%, CRYTUR 10%
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V2	Ztech	Proven technology	ÚPT 0%, BUT CEITEC 0%, CRYTUR 100%	31.12.2020	31.12.2020	CRYTUR 100%
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V7	Gfunk	Lithographic mask	Crytur 100%	31.12.2021	31.12.2021	100 % UPT
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V8	Gfunk	Specimen manipulator	VUT 100%	31.12.2021	5.9.2021	100 % VUT
DP29	TN01000008/22		TN01000008/22-V009	Gfunk	ISI :: High-voltage power supply	ÚPT 100 %	31.12.2022		ÚPT 100 %
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V4	Fuzit	Manipulator with micrometric sample positioning and spectrometer with this manipulator	ÚPT 100%	31.12.2020	08.09.2020	ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V1	Gfunk	Electrostatic column for 2D detection in UHV system (off-axis pixelated detector)	ÚPT 100%	31.12.2020	15.12.2020	ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V2	Ostatni	Very low energy electron transmission spectroscopy of 2D materials	ÚPT 100%	31.12.2020	07.08.2020	ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V3	Ostatni	Study of electron scattering phenomena of advanced materials by UHV SLEEM/ToF	ÚPT 100%	31.12.2020	04.11.2020	ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V5	Gfunk	2D detection system for reflected electrons in UHV SLEEM	ÚPT 100%	31.12.2021	20.12.2021	ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V6	Ostatni	article	ÚPT 100%	31.12.2021	30.07.2021	ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V7	Gfunk	Manipulator with micrometric shift for a miniaturised secondary electron spectrometer	ÚPT 100%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V008	R software	SW for control of electrostatic column equipped with hybrid pixelated detector	ÚPT 100%	31.12.2022		ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V009	Ostatni	Study graphene by ToF spectroscopy	ÚPT 100%	31.12.2022		ÚPT 100%
DP22	TN01000008/23		TN01000008/23-V010	Gfunk	Calibration standard sample for secondary electron spectroscopy in SEM	ÚPT 100%	31.12.2022		ÚPT 100%
DP21	TN01000008/24		TN01000008/24-V1	Gfunk	The tool for correlation of cryo-SEM and cryo-Raman spectroscopy	ÚPT 100%	31.12.2020	18.12.2020	ÚPT 100%
DP21	TN01000008/24		TN01000008/24-V2	Ostatni	The study of PHA producing microorganisms using a combination of cryo-SEM, TEM and Raman spectroscopy	ÚPT 60%, BC 30%, UMCH 10%	31.12.2020	01.07.2020	ÚPT 60%, BC 30%, UMCH 10%
DP21	TN01000008/24		TN01000008/24-V3	Ostatni	conference contribution	ÚPT 70%, BC 10%, UMCH 10%, TFS 10%	31.12.2020	05.09.2019	ÚPT 70%, BC 10%, UMCH 10%, TFS 10%
DP21	TN01000008/24		TN01000008/24-V4	Gfunk	A sample holder for FIB-SEM at low temperature	ÚPT 100%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 100%
DP21	TN01000008/24		TN01000008/24-V005	Gfunk	Cryo-stage and anti-contaminator for FIB-SEM	ÚPT 100 %	31.12.2022		ÚPT 100 %
DP21	TN01000008/24		TN01000008/24-V006	Ostatni	Conference contribution	ÚPT 80 %, BC 20 %	31.12.2022		ÚPT 80 %, BC 20 %
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V1	Gfunk	Pixelated detector for STEM in SEM	TFS 100%	31.12.2020	31.12.2020	TFS 100%
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V2	Gfunk	Pixelated detector for BSE detection in SEM	TFS 100%	31.12.2020	31.12.2020	TFS 100%
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V4	Ostatni	Treatment and Observation of Advanced Carbon-Based Nanomaterials by Slow Electrons	ÚPT 100%	31.12.2020	01.09.2020	ÚPT 100%
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V3	Ostatni	Ultra low voltage STEM of 2D crystals	ÚPT 100%	31.12.2019	31.12.2019	ÚPT 100%
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V5	Gfunk	Tuneable pixelated detector for STEM in SEM	TFS 100%	31.12.2021	31.12.2021	TFS 100%
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V6	Ostatni	2D crystals study using pixelated STEM	ÚPT 100%	31.12.2021	05.07.2021	ÚPT 100%
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V7	Ostatni	Advanced materials study using pixelated STEM	ÚPT 100%	31.12.2021	24.12.2021	ÚPT 100%
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V008	Ostatni	Algorithm enabling automated data collection (report)	TFS 100 %	31.12.2022		TFS 100 %
DP15	TN01000008/25		TN01000008/25-V009	Ostatni	Advantages of new detector in materials science (Research abstract)	ÚPT 100%	31.12.2022		ÚPT 100%
DP19	TN01000008/26		TN01000008/26-V1	Gfunk	Functional sample of temperature measurement.	VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%	31.12.2020	31.12.2020	VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%
DP19	TN01000008/26		TN01000008/26-V2	Gfunk	Functional sample of cryogenic manipulator.	VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%	31.12.2020	31.12.2020	VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%
DP19	TN01000008/26		TN01000008/26-V3	Ostatni	Internal research report	VUT-CEITEC 80%, TFS 0%, MUNI-CEITEC 20%	31.12.2021	31.12.2021	VUT-CEITEC 80%, TFS 0%, MUNI-CEITEC 20%
DP19	TN01000008/26		TN01000008/26-V4	Gfunk	Functional sample of cathodoluminescence-based temperature detection scheme	VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%	31.12.2021	31.12.2021	VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%

DP19	TN01000008/26		TN01000008/26-V005	Gfunk	Cathodoluminescence-based narrow-band temperature detection scheme with gain equilibration routine	VUT-CEITEC 20 %, TFS 80 %	31.12.2022		VUT-CEITEC 20 %, TFS 80 %
DP18	TN01000008/27		TN01000008/27-V2	Gfunk	Specimen insert/retract mechanism proof of concept	TFS 90%, BUT-CEITEC: 10%	31.12.2020	31.03.2020	TFS 95 %, VUT 5 %
DP18	TN01000008/27		TN01000008/27-V1	Gfunk	Sample holder reduction	TFS 100%	31.12.2020	31.05.2020	TFS 100%
DP18	TN01000008/27		TN01000008/27-V3	Gfunk	Specimen holder reducing vibrations	TFS 95%, VUT 5%	31.12.2021	10.12.2021	TFS 95%, VUT 5%
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V2	Ostatni	CryoStage Concept Study	TFS 50%, ÚPT: 50%	30.09.2020	30.09.2020	TFS 50%, ISI: 50%
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V3	Gfunk	Proof of Concept	TFS 50%, ÚPT: 50%	31.12.2020	31.12.2020	TFS 50%, ISI: 50%
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V4	Ostatni	Design study document	TFS 40%, ÚPT: 60%	31.12.2020	31.12.2020	TFS 40%, ISI: 60%
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V1	Ostatni	Literature review	TFS 0%, ÚPT: 100%	30.11.2019	30.11.2019	TFS 0%, ÚPT: 100%
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V5	Gfunk	LN2 Dewar with cold-finger to CryoStage - functional sample v2	TFS 50%, ÚPT: 50%	30.06.2021	30.06.2021	TFS 50%, ÚPT: 50%
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V6	Ostatni	CryoStage thermal experiments and thermal model validations - report	TFS 50%, ÚPT: 50%	30.06.2021	30.06.2021	TFS 50%, ÚPT: 50%
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V7	Ostatni	Study of low temperature thermal resistances and their quality for the better modelling and calculation of coolers	TFS 50%, ÚPT: 50%	31.12.2021	23.12.2021	TFS 50%, ÚPT: 50%
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V008	Ostatni	Feasibility study for LN2 cooled CryoStage enabling both temperature states of the specimen holder	TFS 50 %, ÚPT 50 %	31.12.2022		TFS 50 %, ÚPT 50 %
DP20	TN01000008/28		TN01000008/28-V009	Gfunk	Functional sample for Proof of principle for new Cryostage enabling both temperature state of specimen holder	TFS 50 %, ÚPT 50 %	31.12.2022		TFS 50 %, ÚPT 50 %
DP26	TN01000008/29		TN01000008/29-V1	Gfunk	Robust method for preparation self-blotting nanowire TEM grids	MUNI-CEITEC 60%,VUT-CEITEC20%	31.12.2020	18.12.2020	MUNI-CEITEC 100%
DP26	TN01000008/29		TN01000008/29-V2	Ostatni	Protocol for reproducible preparation of CuOH nanowires on TEM grids	MUNI-CEITEC 75%,VUT-CEITEC25%	31.12.2022	31.12.2021	MUNI-CEITEC 100%
DP26	TN01000008/29		TN01000008/29-V3	Ostatni	Spin wave propagation in corrugated waveguides	MUNI-CEITEC 25%,VUT-CEITEC75%	31.12.2021	31.12.2021	MUNI-CEITEC 0%
DP31	TN01000008/30		TN01000008/30-V1	Gfunk	Specimen holder for the electron induced cleaning in SEM	ÚPT 90%, TFS 10%	31.12.2020	31.12.2020	ÚPT 90%, TFS 10%
DP31	TN01000008/30		TN01000008/30-V2	Ostatni	Methods of the electron induced cleaning in SEM	ÚPT 50%, TFS 50%	31.12.2021	30.07.2021	ÚPT 50%, TFS 50%
DP31	TN01000008/30		TN01000008/30-V003	Ostatni	Contamination mitigation strategy for SEMs	ÚPT 70 %, TFS 30 %	31.12.2022		ÚPT 70 %, TFS 30 %
DP32	TN01000008/31		TN01000008/31-V1	Ostatni	Simulation of gas flow and sample temperature distribution in the micro-reactor device	ÚPT 50%, TFS 50%	31.12.2021	31.12.2021	ÚPT 50%, TFS 50%
DP32	TN01000008/31		TN01000008/31-V002	Ostatni	Mathematical-physical analysis of thermodynamic conditions in the micro-reactor II.		31.12.2022		ÚPT 50%, TFS 50%